

CINOS CLEANING TECHNOLOGY

특허 제 10-1780778호



Super Bubble Clean









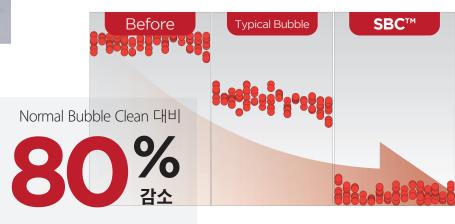


Super Bubble Clean(SBC™)은 다수의 미세한 홀 내부의 Particle 세정을 위한 전용 세정 장치입니다. 반도체 공정에서 사용되는 부품의 홀 내부는 공정상 미세 식각 및 반응 부산물로 표면 거칠기가 균일하지 못하게 되며, 또한 세정액과 모재의 표면 장력 등에 의해 세정액이 미세한 틈 사이로 침투가 원활하지 않게 됩니다. 일반적 침적 방식의 세정은 Particle을 완벽히 제거 불가능하며, Chamber 장착 시 다량의 Particle이 발생됩니다.

Benefits



Normal Bubble보다 100배 작은 크기로 미세한 Particle제거에 우수한 SBC™



SBC™의 Micro Bubble Size로 인해 미세 침투 증대 및 케비테이션 (Cavitation)효과로 홀 내부 변형, 식각, 크기 변화 없이 Micro Size Bubble을 효과적으로 제거할 수 있습니다.

Application



Best SolutionFor Hole Type

SBC™는 **Hole 전 제품 처리 가능**한 기술입니다.

